



## РАСПИСАНИЕ

**по курсу переподготовки «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и управления правами на них» по третьему модулю обучения, 1 сессии и по курсу повышения квалификации «Патентный поиск» 22-24 сентября 2020 года (очное обучение)**

ДАТА	ВРЕМЯ	ТЕМА	ПРЕПОДАВАТЕЛЬ/СПИКЕР
<b>22.09.2020</b>  <b>Вторник</b>  <b>Бережковская</b> <b>набережная, д.30</b>  <b>Аудитория 866</b>	10.00-10.30	Инструктаж по технике безопасности. Интеллектуальная собственность на современном этапе	Д.В. Монастырский
	10.30-11.15 11.20-12.05 12.10-12.55	Системы классификации изобретений	З.Э. Войцеховская
	<b>Обед 45 мин</b>		
	13.40-14.25	Стратегии поиска патентной информации	В.В. Максимова
	14.30-15.15 15.20-16.05	Практические занятия по стратегии поиска	В.В. Максимова
	16.10-16.55 17.00-17.45	Информационные ресурсы на сайте ФИПС (лекция и практика)	А.А. Коборова

<b>23.09.2020</b> <b>Среда</b>  <b>Бережковская</b> <b>набережная, д.30</b>  <b>Аудитория 866</b>	10.00-10.45	<b>Поисковая система на сайте ФИПС (лекция и практика)</b>	<b>Т.Д. Васильева</b>	
	10.50-11.35			
	11.40-12.25			
	12.30-13.15	<b>Поисковая система Patentscope (лекция и практика)</b>	<b>О.В. Тихомирова</b>	
	<b>Обед 45 мин</b>			
	14.00-14.45	<b>Поисковая система Patentscope (лекция и практика)</b>	<b>О.В. Тихомирова</b>	
14.50-15.35				
15.40-16.25	<b>Поиск патентной информации Китая (лекция и практика)</b>	<b>О.Н. Дарина</b>		
16.30-17.15				
<b>24.09.2020</b> <b>Четверг</b>  <b>Бережковская</b> <b>набережная, д.30</b>  <b>Аудитория 866</b>	10.00-10.45	<b>Поисковая система Espacenet(лекция и практика)</b>	<b>Т.Д. Васильева</b>	
	10.50-11.35			
	11.40-12.25			
	12.30-13.15			
	<b>Обед 45 мин</b>			
14.00-14.45	<b>Поиск патентной информации Японии и Кореи (лекция и практика)</b>	<b>О.Н. Дарина</b>		
14.50-15.35				
15.40-16.25				
16.30-17.15	<b>Экзамен</b>	<b>Д.В. Монастырский</b> <b>В.В. Максимова</b> <b>О.В. Тихомирова</b> <b>М.Э. Горбунова</b>		

Примечание: В случае внесения изменений в расписание, информация будет оперативно доведена до всех заинтересованных лиц.